

超高純度ガス小型精製器 Ultra High Purity Compact Gas Purifier

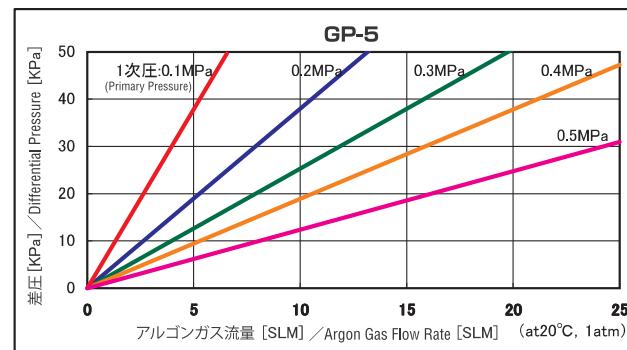


- ユースポイントにおいて、不活性ガスや特殊ガス中に含まれる水分・酸素・ハイドロカーボンなどの不純物を、条件により最大1PPB以下まで除去します。
- 内蔵の粗取り用フィルターメディアには全てSUS316Lを標準として使用しております。腐食によるパーティクルの発生や化学反応を起こしません。
- HBr、HClなどの強腐食性特殊ガス中に含まれる水分を、条件により最大100PPB(分析装置の検出限界)以下まで除去します。
- 小型・軽量モデルGP-05はフィルターサイズ同様の小型タイプ(面間84mm)で、120gと軽量です。
- ガス種により350°Cから400°Cのベーキングによって再活性処理をすれば、完全寿命まで繰り返しご使用になります。
- Use point impurity such as water, oxygen and hydrocarbon included in inactive or special gas removed down to 1PPB or less under certain conditions.
- SUS316L used as standard material for rough filtration media not generating particle by corrosion or chemical reaction.
- Water included in high corrosion special gas such as HBr and HCl removed up to 100PPB (detection limit of analysis equipment) or less under certain conditions.
- Same small size and light weight as GP-05 filter with 84mm face-to-face dimension and 120g in weight.
- Usable until complete lifetime by reactivation process by baking at 350°C to 400°C depending on gas type.

仕様 / Specification

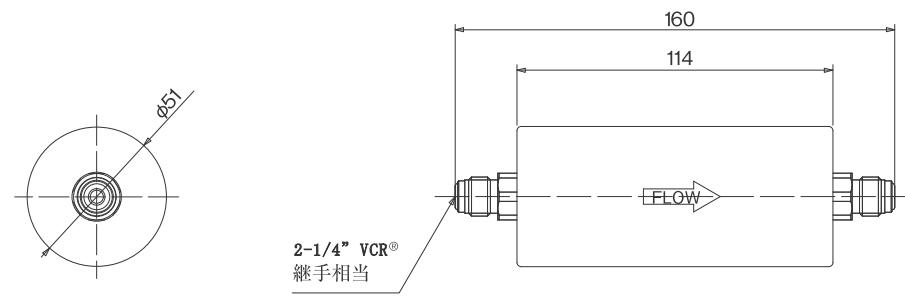
精 製 能 力 Refining Performance	個々の不純物 : 最大1PPB以下 (Each impurity :max 1PPB or less) 出口側不純物合計: 最大10PPB以下(条件による) (Total of impurity on outlet side:max 10PPB or less (depending on the condition))
材 質 Materials	ハウジング(Housing) SUS316L 電解研磨 (Electrochemical polishing) 内面粗度 (Roughness) : R max 0.7μm以下 (or less) フィルターメディア(Filter media) SUS316L、精製剤 (Refining agent) : メタル (metal)・ゲッター(getter)、他 (etc.)
流 量 範 囲 Flow Rate Range	0.5SLM ~ 20SLM (モデル/圧力条件によって異なります) 0.5SLM~20SLM (varies depending on model/pressure condition)
最 高 使 用 圧 力 Max Operating Pressure	0.97MPa (140.65PSIG)
使 用 温 度 Operating Temperature	室温又は350 ~ 400°C (用途により異なります) Room temperature or 300 to 400°C (varies depending on the application)
外 部 漏 量 External Leakage	$2 \times 10^{-11} \text{ Pa} \cdot \text{m}^3/\text{sec}$ (He)以下 (or less)
継 手 Joint	1/4", 3/8", 1/2" ガスケットシール (Gasket seal)、コンプレッションシール (Compression seal)

流量特性 / Flow Rate Characteristics



外形寸法図 / Dimensions

GP/GPF-5-***-02VR



精製保証値 / Guaranteed Refining Value

仕様 Specification	精製対象ガス Gas to be Refined	精製不純物 Refined Impurity	精製保証値 Guaranteed Refining Value
不活性ガス Inactive Gas	He, Ne, Ar, Kr, Xe	H ₂ O, O ₂ , CO ₂	1PPB以下 (or less) (室温にて(at room temperature))
		H ₂ O, O ₂ , CO, CO ₂ , THC	1 PPB以下 (or less) (加熱時(at heating))
		出口(二次)側不純物合計 Total of impurity on outlet (secondary) side	10PPB以下 (or less) (8LOGS)
窒素ガス用 For Nitrogen Gas	N ₂	H ₂ O, O ₂ , CO ₂	1PPB以下 (or less) (室温にて(at room temperature))
		H ₂ O, O ₂ , CO, CO ₂ , THC	1 PPB以下 (or less) (加熱時(at heating))
水素ガス用 For Hydrogen Gas	H ₂ , Ar/H ₂ , N ₂ /H ₂	H ₂ O, O ₂ , CO ₂	1PPB以下 (or less) (室温にて(at room temperature))
		H ₂ O, O ₂ , CO, CO ₂ , THC	1 PPB以下 (or less) (加熱時(at heating))
ハイドロイドガス用 フロンガス用 For Hydrogen Gas For Freon Gas	SiH ₄ , SiCH ₆ , SiH ₂ Cl ₂ , AsH ₃ , PH ₃ , NH ₃ , B ₂ H ₆ H ₂ S, H ₂ Se, GeH ₄ , Ge ₂ H ₆ , CH ₄ , CF ₄ , CCl ₄ , SF ₆	H ₂ O, O ₂ , CO ₂	100PPB以下 (or less) (室温にて(at room temperature))
酸素ガス用 For Corrosive Gas	O ₂ , Air	H ₂ O	100PPB以下 (or less) (室温にて(at room temperature))
		CO ₂	100PPB以下 (or less) (室温にて(at room temperature))
腐食性ガス用 For Corrosive Gas	HBr, HCl, BC ₁ ₃ , BF ₃ , Cl ₂	H ₂ O	100PPB以下 (or less) (室温にて(at room temperature))

※腐食性ガスの純度分析にはFT-IRを使用しました。(検出限界100PPB)

※For purity analysis of corrosive gas, FT-IR was used (detection limit 100PPB).

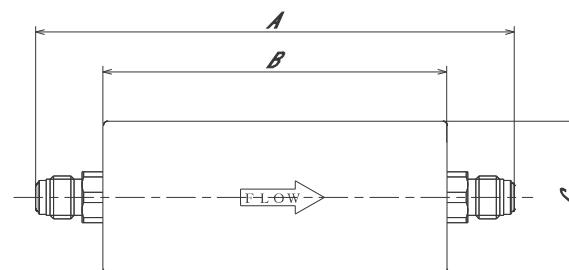
※上記保証値は、入口側不純物合計10OPPM以下の場合

※Guaranteed values above are when total of impurity on inlet side is 10PPM or less.

外形寸法表 / Dimensions table

型式 Model	A(mm)	B(mm)	C(mm)	推奨流量(l/min) Recommended Flow Rate	寿命(流量)※ Lifetime (Flow Rate)
G P - 0 5	84	38	25	0.1 ~ 0.5	約1年間(0.2SLMの時) (Approximately one year (at 0.2SLM))
G P - 1	84	38	38	0.1 ~ 1.0	約1年間(0.5SLMの時) (Approximately one year (at 0.5SLM))
G P - 2	122	76	38	0.2 ~ 2.0	約1年間(0.1SLMの時) (Approximately one year (at 1SLM))
G P - 5	160	114	51	1 ~ 5	約1年間(3SLMの時) (Approximately one year (at 3SLM))
G P - 1 0	224	178	51	2 ~ 10	約1年間(5SLMの時) (Approximately one year (at 5SLM))
G P - 2 0	317	272	63	5 ~ 20	約1年間(10SLMの時) (Approximately one year (at 10SLM))

※上記破過は入口(一次側)からの不純物合計が10OPPMと仮定した場合での値で、この間再活性処理が必要となります。
※Breakthrough above is when total impurity from inlet port (primary side) is assumed to be 10PPM, and reactivation process is required during this period.



ご注文の仕方 / How to Order

内蔵パーティクル遮過エレメント遮過精度 Built-in Particle Filtration Element Removal rating	推奨流量 Recommended Flow Rate	再活性処理用バージガス Purge Gas for Reactivation Process	継手サイズ Bore Diameter	継手 Type of fitting	*1発熱を伴う反応を防ぐため、ガスの種類は正確にご記入願います。 *1. In order to prevent reaction that involves heat generation, please select the type of gas correctly.
GP	05	5	10	20	VR
GP : 5μm以上 5μm or more GPF : 0.01μm以上 0.01μm or more (99.9999%)	0.5SLM 1 : 1SLM 2 : 2SLM	5SLM 10 : 10SLM 20 : 20SLM	H ₂ , HBr, HCl, SiH ₄ その他 other	02: 1/4" 03: 3/8" 04: 1/2" GP/GPF-05 & 1 is 1/4"のみ GP/GPF-05 & 1 is 1/4" only	VR : ガスケットシール継手 Gasket Seal (VCR®対応 (compatible)) SW: コンプレッションシール継手 Compression Seal (Swagelok®対応 (compatible))

登録商標/Registered trademark
VCR®, Swagelok® : Swagelok Company※仕様は予告なく変更されることがあります。※Specification is subject to change without notice.
※腐食性ガスの場合は再活性は出来ません。※In case of corrosive gas purifier, reactivation is not available.